



고 레벨의 더블빔 방식의 채용에 의해 재현성이 좋은 고정밀도의 측정을 간단하게 실시할 수 있으며, HAZE 및 전광선투과율을 신·구 규격 모두 측정이 가능합니다.

종합 분광 특성은, 명소시표준시감 효율  $V(\lambda)$ 와 CIE 표준 광원 D65 및 표준 광원 A와의 배합하고 특성에도 교체됩니다.

연산 및 제어에는, PC를 사용해 각종 계산, 평균 계산 및 프린터 출력이 가능한 전자동형으로 항상

안정된, 측정 결과를 얻을 수 있습니다. 특히 미소측정면적(약 $\Phi 6$ )의 검출이 가능하며, 측정 샘플은 최소  $\Phi 10$ 까지 세팅 할 수 있습니다.



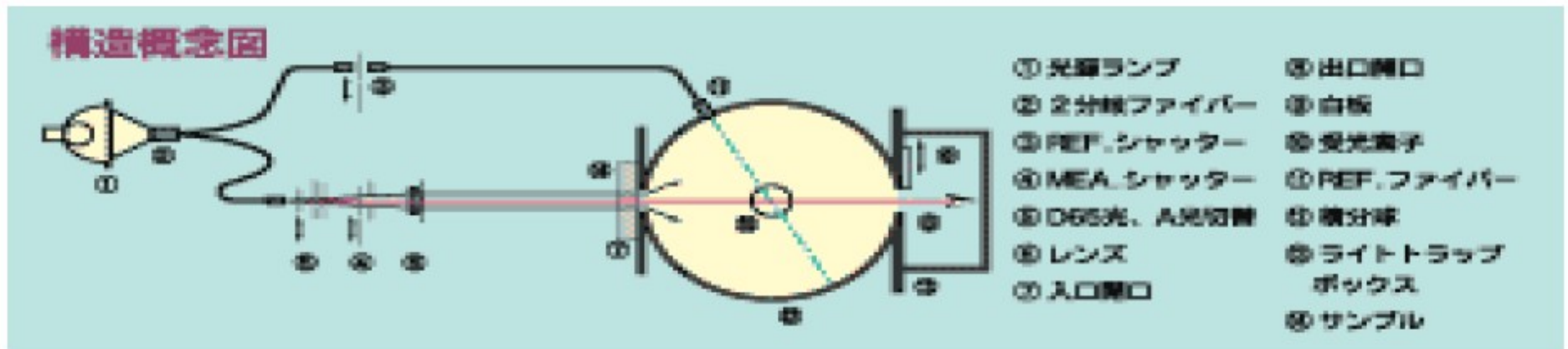
## 주요 사양

시료 형태: 시트 형상(필름, 플라스틱, 유리 등)

측정광속: 입사개구 $\Phi 9$ , 광속 $\Phi 6$

적분구:  $\Phi 65$ (BaSO<sub>4</sub> 도포)

## 장비 구조도



## 장비 사양

						헤ーズ    透過率    3분광    2분광    5분광    10분광 헤이즈    透過율    3분광    2분광    5분광    10분광				
더블빔	할로겐	크레톤	파이버	積分球	실리콘 포토 다이오드	측정시간	測定時間	電源	인터페이스	